

06.2

## О возможности увеличения рабочей частоты мощных биполярных переключателей с распределенными микрозатворами

© А.В. Горбатюк, И.В. Грехов, Д.В. Гусин

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург  
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет  
E-mail: agor.pulse@mail.ioffe.ru

Поступило в Редакцию 17 июня 2010 г.

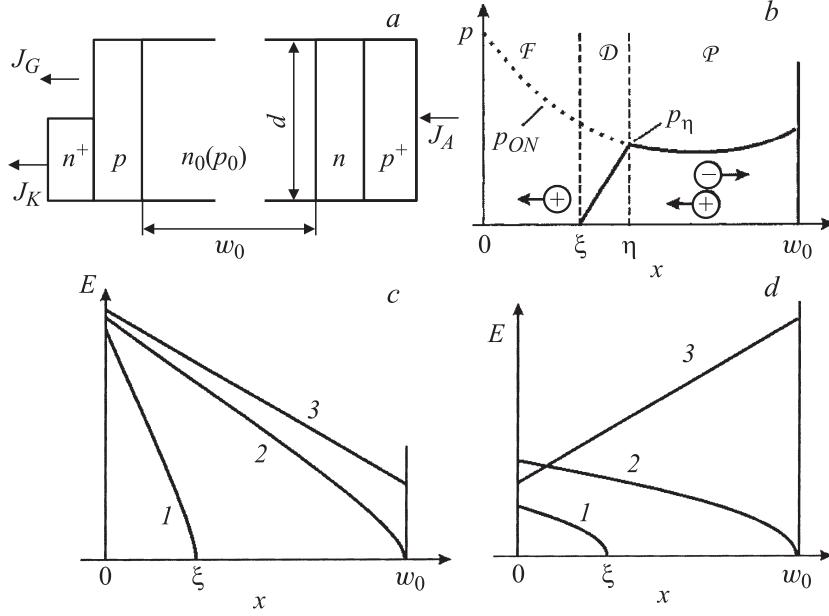
Рассмотрена возможность снижения динамических потерь при выключении мощных биполярных переключателей с распределенными микрозатворами и увеличения их рабочей частоты путем такого выбора конструкции, чтобы заряды, выводимые из высокоомной базы (ВБ), и встроенные заряды примеси ВБ были противоположны по знаку. Так, в приборе с экстрагирующим дырки катодным затвором и с буферным слоем со стороны анода это осуществляется при изменении легирования ВБ с  $n$ - на  $p$ -тип. Построена специальная аналитическая модель процесса выключения такого прибора. Установлено, в частности, что при рабочем напряжении  $\sim 5$  кВ потери за одну операцию могут быть снижены от 200 до 100 мJ/cm<sup>2</sup>, а частота увеличена от 0.5 до 1.0 kHz.

Биполярные переключатели с распределенными микрозатворами (БПМЗ) — класс мощных частотных полупроводниковых ключей нового поколения, объединяющий биполярные транзисторы с изолированными затворами, МОП-управляемые тиристоры, запираемые тиристоры с малоиндуктивным управлением, тиристоры со статической индукцией [1–6] и др. Для БПМЗ с напряжением переключения  $U_{\max} = 1.5$ –2 кВ коммутируемая мощность достигает  $P = 100$  kW/cm<sup>2</sup> при циклической работе на частотах до  $f_{\max} = 1$  kHz. Тем не менее дальнейшее увеличение мощности за счет увеличения величины  $U_{\max}$  до 3–5 кВ и выше или увеличение  $f_{\max}$  представляются невозможными из-за сильного роста тепловых потерь  $W_{OFF}$  на стадии выключения. Причины этих ограничений детально обсуждались в работах [1,2,7,8]. Дело в том, что для восстановления блокирующей способности БПМЗ необходимо

осуществить полное рассасывание избыточного заряда электронно-дырочной плазмы  $Q_{ON}$ , накопленного в высокоомной базе (ВБ) в исходном включенном состоянии. Поскольку увеличение величины  $U_{max}$  возможно только при увеличении толщины ВБ, то будут одновременно действовать два фактора, увеличивающие потери  $W_{OFF}$ . Во-первых, будут увеличиваться полная величина  $Q_{ON}$  и длительность стадии выключения. А во-вторых, увеличится толщина области пространственного заряда (ОПЗ), через которую осуществляется выведение одной из зарядовых компонент плазмы (в БПМЗ с катодными затворами — дырок), следовательно, вырастет и напряжение на этой области.

Как уже упоминалось, природа обсуждаемых ограничений весьма хорошо изучена, и возможности дальнейшего увеличения  $U_{max}$  или  $f_{max}$  для БПМЗ стандартных типов за счет их оптимизации, скорее всего, исчерпаны. Имеется, однако, возможность многократного повышения  $f_{max}$  для БМПЗ некоторых специальных конструкций. Рассмотрим кремниевый БПМЗ с катодным затвором, биполярная  $n^+pn_0pr^+$ -часть структуры которого показана на рис. 1, a. При положительном смещении на аноде включенному состоянию такой структуры соответствует режим затвора  $J_A \simeq J_K \gg J_G$ . Тогда распределение избыточных концентраций вдоль ВБ имеет форму, показанную на рис. 1, b пунктирной кривой  $p_{ON}(x)$ . Выключение структуры достигается при работе затвора в режиме  $J_G \rightarrow J_A; J_K \rightarrow 0$ . При этом инъекция электронов в ВБ резко пресекается, в прилегающей к катоду части образуется ОПЗ, через которую из плазмы экстрагируются дырки, а граница  $\xi$  между плазмой (слои  $\mathcal{D}$  и  $\mathcal{P}$ ) и ОПЗ (слой  $\mathcal{F}$ ) отодвигается к аноду. Заметим, что эта картина не зависит от типа легирования ВБ. Различия возникают только для формы распределения поля  $E$  в ОПЗ. Так, в классическом случае с ВБ  $n$ -типа (рис. 1, c) заряды дырок и встроенных доноров совпадают, поле в ОПЗ изначально (кривые 1 и 2) имеет более высокую крутизну, чем в конечном, блокирующем состоянии (3). Максимум  $E$  при этом всегда остается в призатворной части ВБ. Если же ВБ имеет  $p$ -тип проводимости, то в ОПЗ происходит частичная взаимная компенсация зарядов дырок и встроенных акцепторов. В этом случае крутизна поля на начальных стадиях существенно ниже, чем в предыдущем случае. Этот факт и можно использовать для снижения интеграла переходных потерь  $W_{OFF}$ .<sup>1</sup> Заметим, что смена типа легирования ВБ допустима

<sup>1</sup> Подобная идея была впервые сформулирована в работе [6] для  $n^+pn_0pr^+$ -структур с анодным затвором.



**Рис. 1.** К описанию процесса оттеснения плазмы в БПМЗ областью сильного поля; *a* — эквивалентная геометрия единичной ячейки БПМЗ с катодным затвором; *b* — распределения концентрации плазмы в начальный (пунктирная линия) и промежуточный (сплошная линия) моменты времени; *c* и *d* — профили поля соответственно в структурах  $n^+pn_0np^+$ - и  $n^+pp_0np^+$ -типов на начальной стадии процесса выключения (*1*), в момент прокола слаболегированной базы (*2*) и по достижении стационарного состояния блокировки (*3*).

только в БПМЗ с буферным слоем. В таком БПМЗ максимум  $E$  после момента полного полевого прокола ВБ перемещается к ее прианодной грани. Эта особенность может существенно замедлять последующее включение БПМЗ в частотных режимах, поэтому предлагаемая идея может быть реализована в условиях с полным статическим полевым проколом.

Для оценки эффективности предлагаемой идеи далее строится теоретическая модель, отличающаяся от известных ранее тем, что в ней учитывается зависимость скорости дрейфа дырок от по-

ля  $v_p = \mu_p E (1 + \mu_p E/v_s)^{-1}$  во всем допустимом интервале полей  $0 < E < E_{av}$  (здесь  $\mu_p$  — низкополевая подвижность дырок,  $v_s$  — предельная скорость дрейфа,  $E_{av}$  — пороговое поле лавинного пробоя для Si). Уравнение Пуассона для поля в слое  $\mathcal{F}$  имеет вид:

$$\varepsilon_{\text{Si}} \frac{dE}{dx'} = \pm qN + \frac{J_p}{v_p(E)}, \quad x' = \xi - x. \quad (1)$$

Здесь  $\varepsilon_{\text{Si}}$  — абсолютная диэлектрическая проницаемость кремния,  $q$  — заряд электрона,  $N$  — концентрация примеси, знак „+“ выбирается для доноров, „-“ — для акцепторов. Решение уравнения (1) можно найти как частный случай решений, найденных ранее в работе [9]:

$$\frac{x'}{x^*} = \frac{E}{E^*} - \ln \left( 1 + \frac{E}{E^*} \right), \quad (2)$$

где  $E^* = v_s b J \mu_p^{-1} (J \pm q N v_s)^{-1}$ ,  $x^* = \varepsilon_{\text{Si}} v_s^2 b J \mu_p^{-1} (J \pm q N v_s)^{-2}$ ,  $b = \mu_n / \mu_p$  — отношение подвижностей электронов и дырок. При заданной величине  $J$  толщина домена  $\xi$  и напряжение на нем  $U$  связаны с максимальным полем  $E_m$  как

$$\begin{aligned} \xi &= x^* \left[ \frac{E_m}{E^*} - \ln \left( 1 + \frac{E_m}{E^*} \right) \right], \\ U &= x^* \left[ \frac{E_m^2}{2E^*} - E_m + E^* \ln \left( 1 + \frac{E_m}{E^*} \right) \right]. \end{aligned} \quad (3)$$

Начальным условием для процесса выключения служит стационарное распределение концентраций избыточной плазмы в ВБ на интервале  $0 < x < w_0$ , принятное в работах [7,8]:

$$p_{ON}(x, t=0) = p_{\min} \cosh \frac{x - x_{\min}}{L_h}, \quad L_h = \sqrt{\frac{2bD_p\tau_h}{b+1}}. \quad (4)$$

Здесь  $D_p$  — коэффициент диффузии дырок,  $\tau_h$  — время жизни при высоком уровне инжеекции,  $p_{\min}$  — концентрация в точке  $x_{\min}$  минимума профиля  $p_{ON}(x)$ . Эти параметры определяются коэффициентами инжеекции  $\gamma_K$  и  $\gamma_A$  при  $x = 0$  и  $x = w_0$ . Для описания процесса оттеснения плазмы используем сформулированные в [7,8] законы движения лидирующей  $\eta$

и отстающей  $\xi$  границ слоя  $\mathcal{D}$  (рис. 1, b) между  $\mathcal{F}$  и  $\mathcal{P}$  в периоды до и после  $t = t_1$ , когда  $\eta \rightarrow w_0$ :

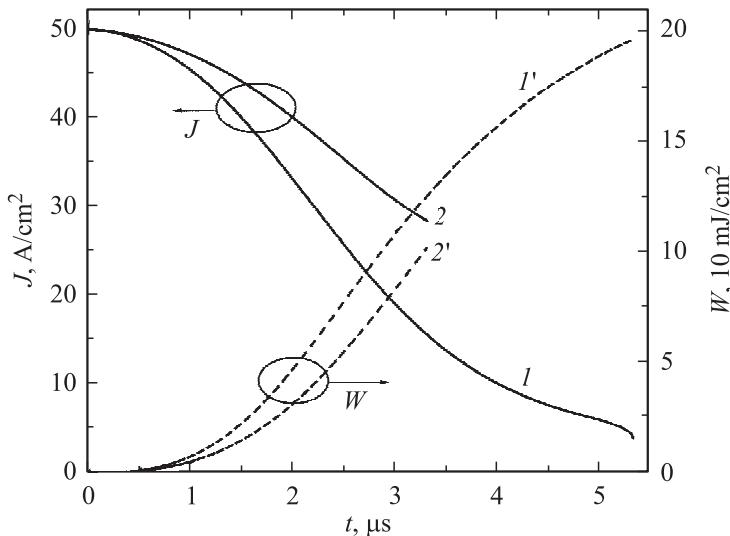
$$qp_\eta \left( 1 - \frac{qD_p}{J} \frac{dp}{dx} \Big|_{x=\eta} \right) \frac{d\eta}{dt} + \frac{q^2 p_\eta^2 D_p}{J^2} \frac{dJ}{dt} = \frac{b}{b+1} J, \quad t \leq t_1; \quad (5)$$

$$\frac{d\xi}{dt} = \frac{w_0 - \xi}{2\tau_h} + 2 \frac{(1 - \gamma_A)D_p}{(w_0 - \xi)} + \frac{(w_0 - \xi)}{2J} \frac{dJ}{dt}, \quad t_{PT} > t > t_1. \quad (6)$$

Здесь  $p_\eta = p_{ON}(\eta)$  — концентрация плазмы в сечении  $x = \eta$ ,  $t_{PT}$  — момент, когда  $\xi \rightarrow w_0$ .

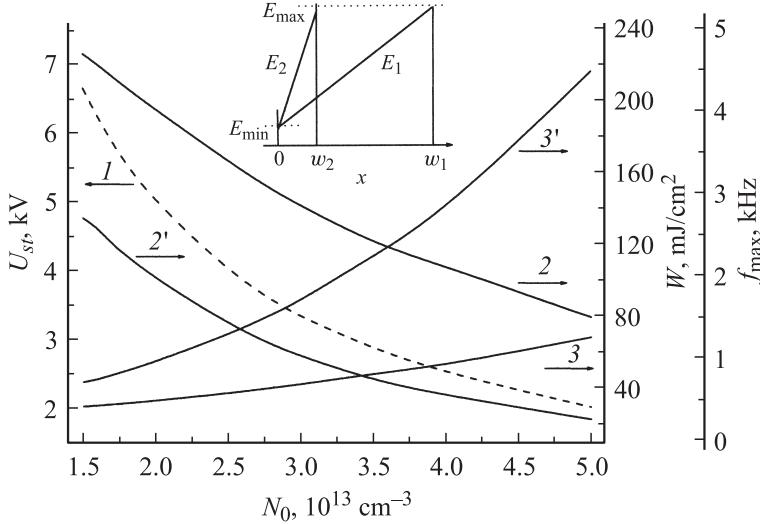
Заметим, что после полного рассасывания избыточной плазмы в ВБ, т.е. для  $U > U_{PT} = qN_D w_0^2 / 2\epsilon_{Si}$ , еще остается некоторый избыточный заряд в буферном слое (БС). Время его рассасывания оценим по формуле  $\tau_{eff} = (\tau^{-1} + 2D/w_N^2)^{-1}$  из теории биполярных транзисторов, где  $\tau$  и  $D$  — время жизни и коэффициент диффузии неосновных носителей в БС, а  $w_N$  — его толщина. При величине  $w_N$  в несколько микрон это время не превышает десяти наносекунд, так что плотность потерь за всю операцию выключения  $W_{OFF}$  можно считать практически равной интегралу потерь, выделяемых до момента полевого прокола.

В последующих расчетах выполнено сравнение двух конструкций БПМЗ с катодным затвором и ВБ  $n$ - и  $p$ -типов проводимости. В качестве начального профиля  $p_{ON}(x)$  задавалось „оптимизированное“ распределение [1,8] с максимумом со стороны затвора и минимумом — с противоположной стороны, что обеспечивалось следующим выбором эффективных коэффициентов инжекции:  $\gamma_K = 0.9$ ,  $\gamma_A = 0.25$ . Для простоты рассматривается работа БПМЗ в цепи с омической нагрузкой  $R$  и эдс  $\mathcal{E}_m$ , когда справедливо уравнение  $U = \mathcal{E}_m - JR$ . Для начального состояния  $J = J_0 = 50 \text{ A/cm}^2$ . На рис. 2 представлены переходные зависимости  $J(t)$  и  $W(t)$  для структур с высокоомной базой  $n$ - и  $p$ -типа (кривые 1, 2 соответственно) при одинаковых параметрах  $N_{D,A} = 2 \cdot 10^{13} \text{ cm}^{-3}$  и  $w_0 = 500 \mu\text{m}$ . Максимальное напряжение статической блокировки  $U_{st}$  такой структуры, оцениваемое по максимальному допустимому полю коллектора  $E_{max} \simeq 1.8 \cdot 10^5 \text{ V/cm}$ , составляет 5 kV. Согласно приведенным данным, в структуре с  $p$ -базой прокол достигается раньше, чем в структуре с  $n$ -базой (соответственно через 3.3 и  $5.3 \mu\text{s}$  после начала запирания). Интегральные тепловые потери  $W_{OFF}$  в первом случае составляют  $101.7 \text{ mJ/cm}^2$ , а во втором —  $196.1 \text{ mJ/cm}^2$ , т.е. выше в 1.9 раза.



**Рис. 2.** Временные зависимости плотности тока ( $1, 2$ ) и мгновенной величины плотности интегральных потерь ( $1', 2'$ ) при выключении БПМЗ в режиме полной отсечки инжекции электронов для случаев с базой  $n$ -типа ( $1, 1'$ ) и  $p$ -типа ( $2, 2'$ ).

Далее мы исследуем, как величина  $W_{OFF}$  при экстракции неосновных и основных носителей зависит от концентрации легирования ВБ  $N = N_D$  или  $N = N_A$ . Для сравнения рассматриваются такие соотношения исходных данных ( $N_{D,A}, w_0, U_{st}$ ), при которых в состоянии статической блокировки поле в максимуме всегда равно  $E_{max} = E_{av} = 1.8 \cdot 10^5 \text{ V/cm}$  (предельно допустимое по отношению к статическому пробою [10]), а в минимуме  $E_{min} = 2 \cdot 10^4 \text{ V/cm}$ , т. е. обеспечивает насыщение скорости дрейфа дырок (см. вставку к рис. 3). На рис. 3 сплошными линиями 2 и 2' показаны расчетные зависимости величин интегральных потерь за одну операцию выключения для структур с базой  $n_0$ - и  $p_0$ -типа соответственно. Найденные значения  $W_{OFF}$  для всех  $U_{st}$  вычислены при задании параметров  $N_{D,A}$  и  $w_0$ , в соответствии с указанным выше условием для блокирующего состояния. Полученные результаты демонстрируют зависимость относительного



**Рис. 3.** Зависимости рабочего напряжения  $U_{st}$  (1), интегральной плотности потерь за одну операцию выключения  $W$  (2, 2') и рабочей частоты в непрерывном режиме  $f_{max}$  (3, 3') для БПМЗ с концентрацией легирования высокоомной базы  $N_0$ . Кривая (1) не зависит от типа легирования базы. Кривые (2, 3) относятся к случаю базы  $n$ -типа, (2', 3') относятся к случаю базы  $p$ -типа. На вставке — к пояснению правил (см. в тексте), связывающих параметры  $w(N_0)$  и  $U_{st}(N_0)$ .

выигрыша в величине интегральных потерь (при переходе от структуры с экстракцией дырок из  $n_0$ -базы к структуре с экстракцией дырок из  $p_0$ -базы) от уровня легирования (соответственно от максимального напряжения блокировки  $U_{st}$ ): наиболее сильное различие потерь имеет место у структур с высоким уровнем легирования  $N$ . С уменьшением  $N$  и повышением напряжения блокировки различие в величине потерь снижается (от 3.5 раз при  $N_0 = 5 \cdot 10^{13} \text{ см}^{-3}$  до 1.7 раз при  $1.5 \cdot 10^{13} \text{ см}^{-3}$ ).

Оценку предельной рабочей частоты БПМЗ выполним для „широко-импульсного“ частотного режима с коэффициентом заполнения 50% и потребуем, как это было сделано в работе [8], равенства статических тепловых потерь за полупериод и переходных потерь за операцию выключения. Тогда предельная частота может быть оценена как  $f_{max} = P_{out}/2W_{OFF}$ , где  $P_{out} \sim 200 \text{ Вт/см}^2$  — приемлемое значе-

ние мощности теплоотвода для кремниевых приборов. Рассчитанные зависимости выходных параметров БПМЗ (напряжения статической блокировки  $U_{st}$ , мощности потерь  $W_{OFF}$  и предельной частоты  $f_{max}$ ) от концентрации легирования ВБ показаны на рис. 3. Видим, в частности, что для прибора с  $N_0 \simeq 2 \cdot 10^{13} \text{ cm}^{-3}$  (с  $U_{st} \sim 5 \text{ kV}$ ) потери за одну операцию при смене легирования ВБ с  $n$ - на  $p$ -тип могут быть снижены от 200 до  $90 \text{ mJ/cm}^2$ , а частота увеличена от 0.5 до 1.0 kHz. При усилении легирования до  $N_0 \simeq 2 \cdot 10^{13} \text{ cm}^{-3}$  (и снижении  $U_{st}$  до 2 kV) значение  $f_{max}$  увеличивается от 1.75 до 4.5 kHz.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 07-08-00689).

## Список литературы

- [1] Cheng K., Udrea F., Amarasinghe G.A.J. // Sol.-St. Electronics. 2000. V. 44. P. 1573–1583.
- [2] Huang S., Udrea F., Amarasinghe G.A.J. // Sol.-St. Electronics. 2003. V. 47. P. 1429–1436.
- [3] Чернявский Е.В., Попов В.П., Пахмутов Ю.С. и др. // Микроэлектроника. 2002. Т. 31. В. 5. С. 376–381, 382–384.
- [4] Бономорский О.И., Воронин П.А. Патент РФ на изобретение № 2199795. Опубл. 27.02.2003. Бюл. № 6.
- [5] Грехов И.В., Мнацаканов Т.Т., Юрков С.Н. и др. // ЖТФ. 2005. Т. 75. В. 7. С. 80–87; ЖТФ. 2006. Т. 76. В. 5. С. 76–81.
- [6] Грехов И.В. Патент РФ на изобретение № 2335824. Опубл. 10.10.2008. Бюл. № 28.
- [7] Горбатюк А.В. // Письма в ЖТФ. 2008. Т. 34. В. 5. С. 54–62.
- [8] Горбатюк А.В., Грехов И.В. // Письма в ЖТФ. 2008. Т. 34. В. 10. С. 61–68.
- [9] Горбатюк А.В. Динамика и устойчивость быстрых регенеративных процессов в структурах мощных тиристоров // Препринт ФТИ им. А.Ф. Иоффе № 962. Л., 1985. 60 с.; Горбатюк А.В., Родин П.Б. // Радиотехника и электроника. 1990. Т. 35. В. 6. С. 1336–1339.
- [10] Горбатюк А.В., Грехов И.В., Гусин Д.В. // ЖТФ. 2009. Т. 79. В. 10. С. 80–88.